

序號	發文日期	發文字號	主旨	備註
1	89.08.01	環署空字第 0041950 號函	一、「半導體製造業空氣污染管制及排放標準」第四條規定：半導體製造業產生之空氣污染物應由密閉排氣系統導入污染防治設備，並處理至排放削減率或工廠總排放量符合規定後始得排放	與現行法規抵觸： 108.9.26 修正發布「公私場所固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」已明定不得以任何形式之處分增加法規所未明定之義務。
2	89.12.07	環署空字第 0068649 號函	一、本署公告第一批公私場所應定期檢測及申報之固定污染源中規定，同一公私場所所屬鍋爐蒸汽產生程序，同一排放口之燃料設計或實際輸入熱值，或同一排放口之設計或實際蒸汽蒸發量達一定量者，應依規定之頻率（三個月、六個月或每年）定期檢測其排放之空氣污染物	已納入至法規位階明文規範： 110.6.6 修正發布「公私場所應自行或委託檢測及申報管理辦法」已重新檢討明定例行性定期檢測調整頻率之「好學生條款」規定。
3	99.01.15	環署空字第 0990005675 號函	貴院函請提供欲成立生產熱能之化工廠，應申請環保證照之相關資料乙案	涉及之法規業廢止： 「生煤、石油焦或其他易致空氣污染物之販賣或使用許可證管理辦法」已刪除
4	101.09.24	環署空字第 1010083389 號函	函詢固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法第 3 條執行疑義一案	已納入至法規位階明文規範： 110.6.6 修正發布「公私場所應自行或委託檢測及申報管理辦法」已明定例行性定檢起始時間。
5	106.07.16	環署空字第 1060053735 號函	函詢小規模營業場違反空氣污染防制法規定之裁處罰鍰額度疑義一案	函釋內容涉及之法規業廢止刪除： 釋示內容引述之環署空字第 0990051354C 號解釋令已停止適用。